

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成17年6月23日(2005.6.23)

【公開番号】特開2003-168566(P2003-168566A)

【公開日】平成15年6月13日(2003.6.13)

【出願番号】特願2001-367454(P2001-367454)

【国際特許分類第7版】

H 05 B 33/22

G 09 F 9/30

H 05 B 33/14

【F I】

H 05 B 33/22 B

G 09 F 9/30 3 3 8

G 09 F 9/30 3 6 5 Z

H 05 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成16年9月29日(2004.9.29)

【手続補正1】

【補正対象書類名】手続補正書

【補正対象項目名】手続補正4

【補正方法】変更

【補正の内容】

【手続補正4】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0048

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0048】

次に、陰極104が形成される。陰極104を形成する材料としては、陰極104からの電子の注入性を向上させるために仕事関数が3.8eV以下の仕事関数の小さい材料を用いる。なお、陰極104が透光性を有する場合には、陰極104の可視光に対する透過率は40%以上であることが好ましい。一方、陰極104が遮光性を有する場合には、陰極を形成する膜に対する可視光の透過率が10%未満となるように形成する。例えばA1、Ti、W、等からなる単層膜や、仕事関数の小さい材料との積層膜により形成する。